

Appareils de caractérisation de surface installés au CIRIMAT			17 novembre 2023
Appareil	Spécificités	Lieux	Responsables
Microscope optique 3D Keyence VHX-1000	Variation de focus, x20 → x5000, topographie 3D	UPS Chimie salle 28	M.-C. Barthelemy, V. Baylac
Micoscope optique Nikon Epiphot	Microscope de métallographie inversé	UPS Chimie salle 1074	M.-C. Barthélémy
Visionneuse Vision Engineering	Visionneuse avec plage de grossissement de 1 à 300 fois	UPS Chimie salle 15	M.-C. Barthelemy, V. Baylac
Microscope confocal interferometrique Sensofar s-Neox	Etat de surface, rugosité, Variation de focus, confocal, interférometre	UPS Chimie Salle 28	V. Baylac
Microscope optique numérique 3D	Images 2D, pavage, 3D, x6 à x5000	ENSIACET salle 0-R1-5	Y. Thebault
Profilométrie mécanique	Etat de surface, rugosité, mesure de marche, cartographie (3D), scan de qq mm à 10 cm	ENSIACET salle 0-a1-18	C. Tendero
Angle de contact DIGIDROP	Mesure d'angle de contact avec différents liquides	ENSIACET salle 0-a1-11	D. Samélor
Zétamètre ZETACAD	Mesure du potentiel Zeta (de substrat plan, poudres, fibres)	ENSIACET salle 0-a1-11	D. Samélor
XPS Kalpha ThermoScientific	Anticathode Al, monochromateur, $P < 5 \cdot 10^{-9}$ mbar, spot X 30 - 400µm	ENSIACET salle 0-R2-9	J. Esvan
AUGER microLab350 ThermoScientific	FEG cathode Schottky, $P < 5 \cdot 10^{-9}$ mbar, évaporateur	ENSIACET salle 0-R2-5	J. Esvan